

дырки в основном локализуются в р-области, обусловливая иной ход зависимости $M_x(T)$, связанный с рассеянием на примесных атомах. Зависимости средней концентрации дырок \bar{p} по структуре от температуры для образцов „а“ и „в“ приведены на рис. 2 штриховыми линиями.

В заключение авторы выражают благодарность Ю.Н. Дроздову за предоставление рентгеноdifракционных данных по образцам и А.В. Кожухову за проведение масс-спектрометрического анализа.

Список литературы

- [1] Gossard A.C. // IEEE Trans. Electron. Dev. 1982. V. 29. N 10. P. 1659.
- [2] Vandewalle C.G., Martin R.M. // Phys. Rev. B. 1986. V. 34. N 8. P. 5621.
- [3] Орлов Л.К., Кузнецов О.А. Тезисы докладов 19 Международной конференции по физике полупроводников. Варшава. 1988. №е-Р-68.

Поступило в Редакцию
1 августа 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 21

12 ноября 1989 г.

06.3; 12

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ *AlGaAs* - ГЕТЕРОЛАЗЕРОВ С ТОКОВЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ В РЕЖИМЕ ВНУТРЕННЕЙ МОДУЛЯЦИИ ДОБРОТНОСТИ

Е.Л. Портной, Н.М. Стельмак,
А.В. Челноков

1. Настоящая работа продолжает наши исследования пикосекундных инжекционных лазеров, полученных глубокой имплантацией тяжелых ионов в зеркала резонатора [1, 2]. В таких лазерах в режиме внутренней модуляции добротности достигаются рекордные параметры по мощности и длительности генерируемых световых импульсов [2]. В работе показано, что насыщающийся поглотитель, находящийся вблизи зеркала лазерного резонатора, существенным образом влияет также и на пространственные характеристики излучаемого импульса.

Эффект изменения пространственных характеристик иллюстрирует рис. 1. Ввиду порогового характера просветления условия генерации достигаются лишь в области максимума интенсивности спонтанного излучения.

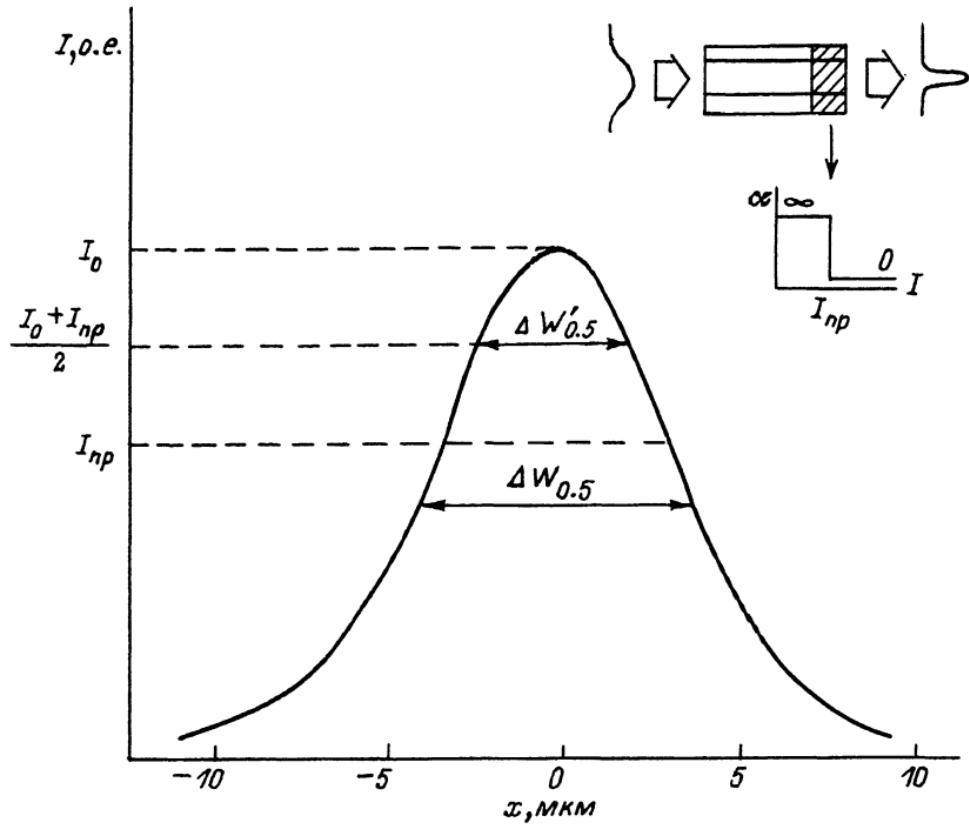


Рис. 1. Эффект сужения тела излучения в присутствии насыщающегося поглотителя.

2. Исходные образцы представляли собой $AlGaAs$ полосковые непрерывные гетеролазеры с шириной полоскового контакта 15 мкм с SiO_2 изоляцией. Длина лазерного резонатора составляла 200±10 мкм. Длина волны излучения $\lambda \approx 830$ нм. Исходные пороговые токи находились на уровне 100 мА.

Облучение проводилось ионами азота в оба зеркала резонатора. Дозы облучения составляли $5 \cdot 10^{11}$ - $4 \cdot 10^{12}$ ион/см² при энергии облучающих ионов 17 МэВ и $3 \cdot 10^{11}$ - $2 \cdot 10^{12}$ ион/см² при энергии 26.7 МэВ. Глубина проникновения ионов для данных энергий составляла соответственно 8-10 и 14-16 мкм.

3. Исследования ближнего и дальнего полей проводилось на ЭОП с временной разверткой и системой автоматической обработки видеинформации. Схема установки показана на рис. 2. Для обеспечения одинакового времени прохождения сигналов по участкам схемы, формирующими изображения ближнего и дальнего полей, а также для компактности установки общая оптическая схема имела конфигурацию интерферометра Майкельсона. Изображение ближнего поля создавалось на входной щели ЭОП микрообъективом M_1 -С-В-С-Д. Часть пучка ответвляется полупрозрачным зеркалом на микрообъектив M_2 , однотипный с M_1 . Зеркало А вместе с перемещаемым

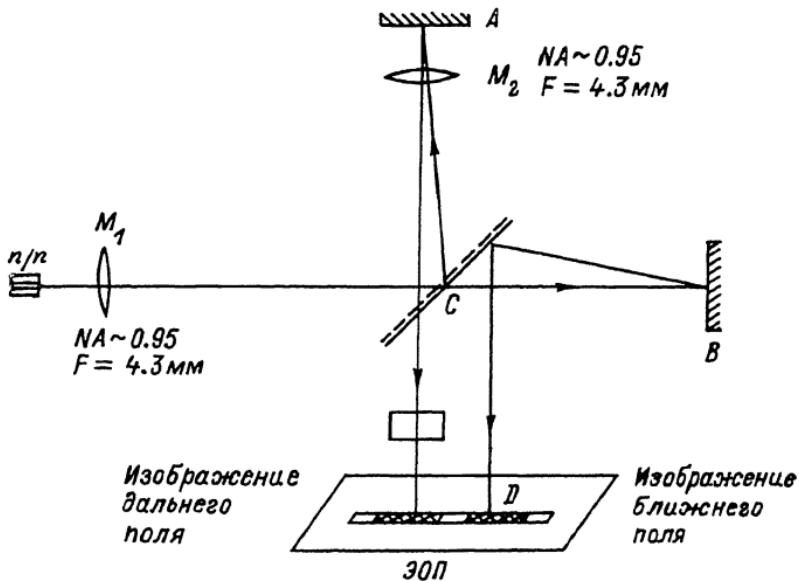


Рис. 2. Схема экспериментальной установки для определения распределений ближнего и дальнего полей с пикосекундным разрешением во времени.

относительно него объективом M_2 образуют аналог рассеивающей линзы с переменным фокусным расстоянием. Такая конструкция позволяет трансформировать сходящийся пучок от микрообъектива M_1 в изображение дальнего поля на входной щели ЭОП. Цилиндрическая линза M_3 служит для увеличения отношения „сигнал-шум“ изображения дальнего поля.

Для юстировки и калибровки системы нами применялся специальный тест-объект, представлявший собой калиброванное отверстие диаметром 25 ± 3 мкм. В случае калибровки дальнего поля тест-объект освещался параллельными пучками двух полупроводниковых лазеров с длиной волны излучения 0.83 мкм и углом 28 градусов между ними. Для калибровки распределения ближнего поля тест-объект освещался некогерентным светом для устранения интерференционных явлений. Параметры измерительного комплекса обеспечивали точность измерения распределений: по углу – 3 градуса, ближнего поля – 0.8 мкм, временное разрешение – около 10 пс.

Типичный пример ближнего и дальнего полей излучения приведен на рис. 3. Измерения и обработка делаются в предположении о гауссовой форме импульса [3, 4]. Вычисление расстояния от зеркала лазерного резонатора до области мнимой перетяжки производилась по формуле

$$D = \frac{\lambda}{\pi \cdot \tan^2 \theta} \left[\frac{\pi \cdot w \cdot \tan \theta}{\lambda} - 1 \right]^{1/2},$$

где θ – полуширина диаграммы направленности по уровню $1/e^2$ рад; w – полуширина распределения ближнего поля по уровню $1/e^2$ мкм, λ – длина волны излучения, мкм.

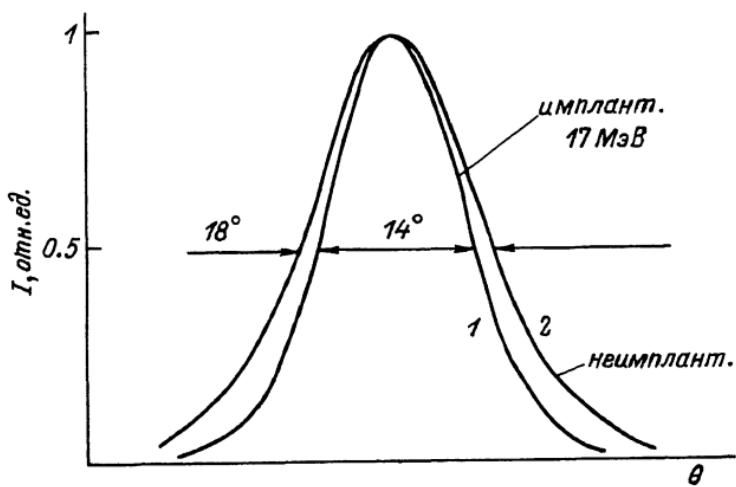
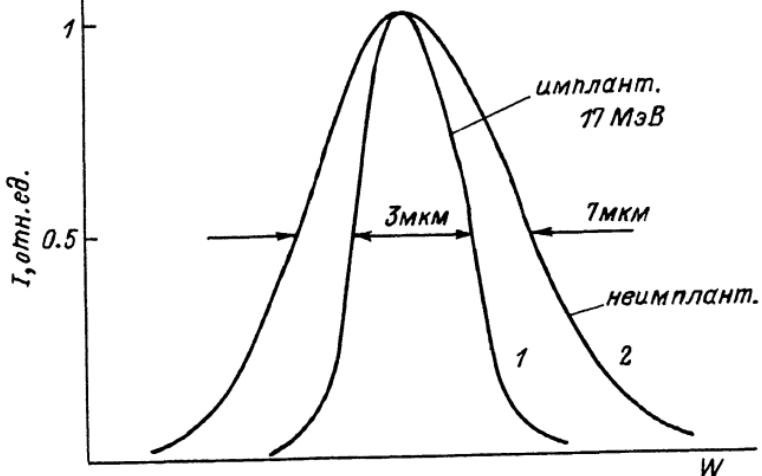


Рис. 3. Ближнее (а) и дальнее (б) поля излучения пикосекундного инжекционного лазера и пример определения ΔW_{05} и $\Delta \theta_{05}$ ($I_u = 2 I_{th}$, T накачки = 5 пс). Кривые 1 – имплантация ионами с энергией 17 МэВ; 2 – без имплантации.

Результаты измерений параметров ближнего и дальнего полей излучения гетеролазеров с насыщающимся поглотителем приведены в табл. 1.

Во всех таблицах ΔW – ширина распределения ближнего поля ($FWHM$), $\Delta \theta$ – ширина диаграммы направленности ($FWHM$), λ – длина волны, x – среднее значение параметра, s – среднеквадратичное отклонение. Параметр $\Delta \theta \Delta W / \lambda$ характеризует степень „идеальности“ параметров $\Delta \theta$ и ΔW по отношению к дифракционному пределу, который для гауссовой формы распределения дальнего и ближнего полей равен 0.441.

Таблица 1

Тип	Объем выборки	ΔW , мкм			$\Delta \theta$, град			λ , мкм	D , мкм			$\Delta \theta \Delta W / \lambda$, отн. ед.	
		n	x	s	x	s	x		x	s	x	x	s
Имплантированные образцы	7	3.0	0.3	14	3	0.828	11	1.5	0.9	0.15			

Таблица 2

Тип	Объем выборки	ΔW , мкм			$\Delta \theta$, град			λ , мкм	D , мкм			$\Delta \theta \Delta W / \lambda$, отн. ед.	
		n	x	s	x	s	x		x	s	x	x	s
Неимплантированные образцы	7	7	1	18	4	0.028	21	2.5	2.7	0.9			

Таблица 3

Тип	Объем выборки	ΔW , мкм			$\Delta \theta$, град			λ , мкм	D , мкм			$\Delta \theta \Delta W / \lambda$, отн. ед.	
		n	x	s	x	s	x		x	s	x	x	s
Имплантированные лазеры E-26 МэВ	3	3.0	0.15	11.5	1.0	0.825	14	0.6	0.8	0.01			

Таблица 4

Тип	Объем выборки	ΔW , мкм			$\Delta \theta$, град			λ , мкм	D , мкм			$\Delta \theta \Delta W / \lambda$, отн. ед.	
		n	x	s	x	s	x		x	s	x	x	s
Неимплантированные лазеры, короткая накачка 0.5 нс	3	6.4	0.5	13.5	2.5	0.823	27	4	1.9	0.5			

Поведение исходных неимплантированных структур существенно отличается от вышеприведенных. Измерения пространственных характеристик неимплантированных лазеров в тех же условиях показали (см. табл. 2) значительно большие ширины диаграмм направленности и распределения ближнего поля.

Как видно из табл. 1, глубина расположения мнимой перетяжки выходного пучка оказывается близкой к продольному размеру насыщающегося поглотителя. Интересно, что для поглотителя с длиной 14–16 мкм, полученного облучением азотом с энергией 26 МэВ, эта глубина соответствовала 14 мкм (табл. 3).

Питание лазеров осуществлялось 5 нс импульсами тока с регулировкой амплитудой от 0 до 1 А. При исследовании хронограмм ближнего и дальнего полей в случае многопичкового режима излучения измерения параметров производились по первому пичку.

Сравнение характеристик имплантированных лазеров с характеристиками исходных структур, накачиваемых короткой (0.5 нс) электрической накачкой, показало, что сужение ближнего поля обусловлено не самофокусировкой [4], а нелинейностью просветления насыщающегося поглотителя, т. к. в этом режиме мощностные параметры импульсов практически одинаковы.

Таким образом, благодаря введению насыщающегося поглотителя в резонатор полупроводникового лазера происходит одновременное существенное сужение диаграмм ближнего и дальнего полей генерируемого лазером пикосекундного светового импульса. Получены необычные пространственно-временные характеристики полупроводникового лазера с токовым ограничением в режиме внутренней модуляции добротности при ширине полоскового контакта 15 мкм: 1 – ширина тела излучения (по уровню 0.5) до 2 мкм, 2 – пиковая мощность в импульсе: до 5 Вт, 3 – длительность импульса: 5–10 нс, 4 – ширина диаграммы направленности (по уровню 0.5) в плоскости перехода: 10 градусов; в плоскости, перпендикулярной переходу: 45 градусов.

В заключение авторы хотели бы поблагодарить академика Ж.И. Алферова за постоянное внимание и поддержку проводимых работ, а также В.О. Найденова, Г.М. Гусинского и Л. Рассадина за предоставление возможности проведения имплантаций.

Список литературы

- [1] Алферов Ж.И., Журавлев А.Б., Портной Е.Л., Стельмах Н.М. // Письма в ЖТФ. 1986. Т. 12. В. 18. С. 1093–1097.
- [2] Портной Е.Л., Стельмах Н.М., Челноков А.В. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. В. 11. С. 44–48.
- [3] Cook D.D., Nash F.R. // J. Appl. Phys. 1975. V. 46. N 3. P. 1660–1672.
- [4] Kirkby P.A., Goodwin A.R., Thompson G.H.B. Selway P.R. // IEEE.J. of QE.1977.VQE-13.N8.P.705–71